T1 検索をする

- 1) 簡易的な検索
- 2) 絞り込み検索
- 3) グループ化
- 4) エクスポートして excel 等で検索

(参考)項目を増減させる

1) 簡易的な検索

 三 設備一覧 次へ 検索 所在キャンパス▼ *大岡山 ----1 ~ 20 / 89 = 設備名称 0 ☰ 設備表示名 ≡ メーカー 三型番 = 所在キャンパス▲ ≡ 所在建物 = 設備所屋 207 拾衣 検索 検索 検索 *大圈山 検索 検索 (i) Cylindrical grinder-Design and Manufactu... G-18-DM-OFC Shigiya G-18 Ookayama/大圈山 Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 electrical discharge machine (EDM)-Desig... AG600L LP20W-DM-OFC Sodick AG600L LP20W <u>Ookayama/大圈山</u> Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 Radial arm drill press-1-Design and Manu... HS-915-DM-OEC CHIYODA HS-915 Ookayama/大圈山 Ishikawadai Bldg 5/石川台5号館 設計製作部門 (i) Osmium coater-Materials Analysis Divisio... NeocPro-MA-OFC Meiwafosis NeocPro <u>Ookayama/大圈山</u> (空) 分析部門 Lathe-2-Design and Manufacturing Divisio... AM-20 <u>Ookayama/大岡山</u> Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 (i) AM-20-DM-OFC IKEGAI (i) Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi... AQ325L-DM-OFC Sodick AQ325L <u>Ookayama/大圈山</u> Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 (i) Welding Machine-2-Design and Manufacturi... KR-500-2-DM-OFC DAIHEN KR-500 Ookayama/大圈山 Ookayama/大岡山 Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 TAC-360 CNC/Manual Lathe-2-Design and Manufactur... TAC-360-1-DM-OFC Takisawa Ookayama/大岡山 (i) Laser diffraction particle size analyzer... SALD-2300-MA-OFC Shimadzu SALD-2300 (空) 分析部門 Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門 (i) drill press-2-Design and Manufacturing D... B13R-2-DM-OFC HITACHI B13R Ookayama/大圈山 (i) Buff Grinder (with Dust Collector)-Desig... FB-10T-DM-OFC YODOGAWA FB-10T Ookayama/大圈山 Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号館 設計製作部門 Welding Machine-4-Design and Manufacturi... GEMMY16 CPS-160-DM-OFC DAIHEN GEMMY16 CPS-160 Ookayama/大圈山 Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号館 設計製作部門 PROFILE PROJECTOR PI311-DM-OEC MITUTOYO (j) Profile Projector-Design and Manufacturi... PROFILE PROJECTOR PI311 <u>Ookayama/大圈山</u> Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館 設計製作部門

表示されている検索欄から項目を指定し、検索ボックスに語句を入力することで検索が可能です。

上図では、検索ワードに「*大岡山」と入力することで、所在キャンパスが大岡山となっている設備の一 覧を表示しています。

【注意】ServiceNowの検索は「前方一致(~から始まる)」であるため、値が英日併記となっている項目(設備表示名・所在キャンパス・所在建物)の場合は日本語を入力してもヒットしません。そのため日本語で検索する場合は日本語の前にアスタリスク(*)を加えることで、「部分一致(検索ワードを含む)」で検索結果が表示されます。

2) 絞り込み検索

複数の条件で絞り込みをかける場合は、左上の虫メガネをクリックすることで、各項目に検索ボックス が表示されます(技術的な問題から表示されないものもあります)。

=	設備一覧	次へ 検索 所在キャンパス▼ 検索					44.4	1 ~ 20 / 89 ► ►►
<u>نې</u>	Q	☰ 設備表示名	☰ 設備名称	≡メーカー	■ 型番	■ 所在キャンパス ▼	☰ 所在建物	= 設備所属
		*電子顕微鏡	検索	検索	検索	*大岡山	検索	検索
	i	Cylindrical grinder-Design and Manufactu	G-18-DM-OFC	Shigiya	G-18	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号館	設計製作部門
	(i)	electrical discharge machine (EDM)-Desig	AG600L LP20W-DM-OFC	Sodick	AG600L LP20W	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	設計製作部門
	(j)	Radial arm drill press-1-Design and Manu	HS-915-DM-OFC	CHIYODA	HS-915	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	設計製作部門
	(i)	Osmium coater-Materials Analysis Divisio	NeocPro-MA-OFC	Meiwafosis	NeocPro	<u>Ookayama/大岡山</u>	(空)	分析部門
	(i)	Lathe-2-Design and Manufacturing Divisio	AM-20-DM-OFC	IKEGAI	AM-20	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg <u>, 5/石川台5号館</u>	設計製作部門
	(i)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AQ325L-DM-OFC	Sodick	AQ325L	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館</u>	設計製作部門
	(i)	Welding Machine-2-Design and Manufacturi	KR-500-2-DM-OFC	DAIHEN	KR-500	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	設計製作部門
	(i)	CNC/Manual Lathe-2-Design and Manufactur	TAC-360-1-DM-OFC	Takisawa	TAC-360	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg <u>, 5/石川台5号館</u>	設計製作部門
	(i)	Laser diffraction particle size analyzer	SALD-2300-MA-OFC	Shimadzu	SALD-2300	<u>Ookayama/大岡山</u>	(空)	分析部門
	(i)	drill press-2-Design and Manufacturing D	B13R-2-DM-OFC	HITACHI	B13R	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	設計製作部門
	(i)	Buff Grinder (with Dust Collector)-Desig	FB-10T-DM-OFC	YODOGAWA	FB-10T	Ookayama/大圈山	Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号館	設計製作部門
	(j)	Welding Machine-4-Design and Manufacturi	GEMMY16 CPS-160-DM-OFC	DAIHEN	GEMMY16 CPS-160	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg <u>. 5/石川台5号館</u>	設計製作部門
	(j)	Profile Projector-Design and Manufacturi	PROFILE PROJECTOR PJ311-DM-OFC	ΜΙΤυτογο	PROFILE PROJECTOR PJ311	<u>Ookayama/大岡山</u>	Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号館	設計製作部門

例えば、大岡山にある電子顕微鏡を検索する場合は、所在キャンパスに「*大岡山」と入力、設備表示名に「*電子顕微鏡」を入力し enter キーを押すことで絞り込み検索が実行されます。

5	Q	☰ 設備表示名		≡メーカー	■型番		☰ 所在建物	= 設備所屋
		*電子顕微鏡	検索	検索	検索	*大岡山	検索	検索
	(j)	Transmission Electron Microscope (TEM)-1	H7650 Zero.A-MA-OFC	Hitachi High-Technologies	H7650 Zero.A	<u>Ookayama/大国山</u>	(空)	分析部門
	(j)	Vacuum evaporator-Materials Analysis Div	JEE-420T-MA-OFC	JEOL	JEE-420T	Ookayama/大国山	(空)	分析部門
	(j)	Scanning Electron Microscope (SEM-EDS)-M	VE-9800-MA-OFC	Keyence	VE-9800	<u>Ookayama/大国山</u>	(空)	分析部門
	(j)	Field Emission Scanning Electron Microsc	JSM-7500F-MA-OFC	JEOL	JSM-7500F	<u>Ookayama/大国山</u>	(空)	分析部門

【注意】ServiceNowの検索は「前方一致(~から始まる)」であるため、値が英日併記となっている項 目(設備表示名・所在キャンパス・所在建物)の場合は日本語を入力してもヒットしません。そのため日 本語で検索する場合は日本語の前にアスタリスク(*)を加えることで、「部分一致(検索ワードを含む)」 で検索結果が表示されます。

3) グループ化

グループ化して目視で探す方法もあります。

=	三 設備一覧次へ 検索 所在違物 ▼ 検索								
<u>نې</u>	Q	☰ 設備表示名	☰ 設備名称	≡メ−カ−	三型番	≡ 所在キャンパス	= 新女神伽 . =	設備所属	
		検索	検索	検索	検索	検索	ソート(陸順)	素	
	(j)	MultiBeam System-Materials Analysis Divi	JIB-4500-MA-OFC	JEOL	JIB-4500	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	グループ解除 次でグループ化:所在建物	185P9	
	(j)	Scanning Electron Microscope (SEM)-2-Mat	JSM-IT100-MA-OFC	JEOL	JSM-IT100	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	(棒グラフ 四グラフ	语印門	
	(j)	Osmium coater-Materials Analysis Divisio	NeocPro-MA-OFC	Meiwafosis	NeocPro	<u>Ookayama/大圈山</u>	(インタラクティブ分析の起動	i君GP門	
	(j)	Laser diffraction particle size analyzer	SALD-2300-MA-OFC	Shimadzu	SALD-2300	<u>Ookayama/大圈山</u>	(エクスポート >	语印門	

例えば、所在建物の左にある「三」をクリックし、次でグループ化:所在建物を選ぶことで、所在建物で グループ化されたリストとなります。

■設備	三 設備一覧 次へ 検索 所在建物 ▼ 検索								
• 🔅	Q	☰ 設備表示名	☰ 設備名称	≡メ−カ−	三 型番	≡ 所在キャンパス	☰ 所在建物 🔺	161 合計設備一覧 ☰ 設備所屋	
		検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索	
▶ <u>所在建</u> (<u>物:(空)(</u>	34)							
• <u>所在建</u>	物: G3 Bl	dg. <u>/G3揀 (3)</u>							
	(j)	Scanning Electron Microscope(SEM)-Facili	SU8020-FS-OFC	Hitachi High-Tech Corporation	SU8020	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>G3 Bldg./G3</u> 揀	ファシリティステーション	
	(j)	X-ray Photoelectron Spectroscopy(XPS)-Fa	PHI VersaProbe 3-FS-OFC	ULVAC-PHI, Inc.	PHI VersaProbe 3	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>G3 Bldg./G3棟</u>	ファシリティステーション	
	i	Raman Spectroscopy-Facility Station-Open	XploRA PLUS-FS-OFC	HORIBA, Ltd.	XploRA PLUS	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>G3 Bldg./G3棟</u>	ファシリティステーション	
▶ <u>所在建</u>	物: Ishika	awadai Bldg. 5/石川台5号館 (62)							
▶ <u>所在建</u>	物: J1 Blo	<u>dg./J1棟(1)</u>							
▶ <u>所在建</u>	物: Other	<u>Bldg./その他建物 (1)</u>							
▶ <u>所在建</u>	物: R1 An	nex B/R1-B棟 (5)							
▶ <u>所在建</u>	物: R1 Bl	<u>dg./R1楝 (13)</u>							
▶ <u>所在建</u>	物: R2 An	nex A/R2-A楝 (21)							
▶ <u>所在建</u>	物: R3 Bl	dg./R3高層棟・低層棟(17)							
▶ 所在建	物: South	n Bldg. 7/大岡山南7号館(4)							

各グループで展開・折り畳みができるため、目的とする建物にある設備を見つけることも可能です。

4) エクスポートして excel 等で検索

3) グループ化と同様に項目左にある「三」 をクリックし、リストを excel ファイルにエクスポートできます。

	設備一覧	次へ 検索 設備表示名 ▼ 核	索				1 ~ 20 / 89		
<u>نې</u>	Q	☰ 設備表示名 ▼	☰ 設備名称	=	キャーゴロ リート (見順)	≡メーカー	≡ 型番	≡ 所在キャンパス	☰ 所在建物
		検索	検索		ソート(喧順)	検索	検索	*大岡山	検索
	(j)	X-ray diffraction for thin film-Material	X'Pert pro MRD-MA-OFC	63	グループ解除 次でグループ化:カテゴリ	PANalytical	X'Pert pro MRD	Ookayama/大圈山	South Bldg, 7/大岡山南7号館
	(j)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AD-325L LN1W-DM-OFC	32	棒グラフ 円グラフ	Sodick	AD-325L LN1W	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号</u> 館
	i	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AQ325L-DM-OFC	32	インタラクティブ分析の起動	Sodick	AQ325L	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号</u> 館
	i	Welding Machine-7-Design and Manufacturi	PANA-AUTO 350D-DM-OFC	32- 置		Excel (.xlsx) CSV	PANA-AUTO 350D	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号</u> 館
	(j)	Welding Machine-6-Design and Manufacturi	KSパンダ-DM-OFC	324 置	:電気溶接機及びガス溶接・溶断機	JSON PDF >	KSパンダ	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg, 5/石川台5号</u> 館

(参考) 項目を増減させる

表示されている項目を増やす場合には上部左の歯車をクリックします。

三 設備一覧 次へ 検索 設備表示名 ▼ 検索									
1	Q	☰ 設備表示名 ▼	☰ 設備名称	≡ カテゴリ	≡メ−カ−	≡ 型番	≡ 所在キャンパス	☰ 所在建物	
		検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索	
	i	XRD-test	X-ray Diffraction				other	<u>Other Bldg./その他建物</u>	
	(j)	X-ray Photoelectron Spectroscopy(XPS)- Ea	PHI VersaProbe 3-FS-OFC	636-JSIA040314:光電子分光装置(XPS、 ESCA)	ULVAC-PHI, Inc.	PHI VersaProbe 3	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>G3 Bldg./G3棟</u>	
	i	X-ray DSC (XRD-DSC)-Materials Analysis D	XRD-DSC-MA-OFC	636-JSIA040301:X線回折装置	Rigaku	XRD-DSC	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>R1 Bldg./R1棟</u>	
	(j)	X-ray diffraction for thin film-Material	X'Pert pro MRD-MA-OFC	636-JSIA040301:X 線回折装置	PANalytical	X'Pert pro MRD	<u>Ookayama/大国山</u>	South Bldg. 7/大岡山南7号館	
	(j)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AD-325L LN1W-DM-OFC	32181:放電加工機	Sodick	AD-325L LN1W	<u>Ookayama/大圈山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号</u> 館	
	(i)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AQ325L-DM-OFC	32181:放電加工機	Sodick	AQ325L	<u>Ookayama/大圈山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石川台5号</u> 館	

リストの列をカスタマイズにおいて、「利用可能開始時間」「利用可能終了時間」を右に移動させ【OK】

をクリックすると



表に項目が追加されます。

<u>نې</u>	Q	☰ 設備表示名 ▼	☰ 設備名称	≡ カテゴリ	≡メーカー	☰型番	≡ 所在キャンパス	☰ 所在建物	■ 利用可能開始時間	■利用可能終了時間
		検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索	検索
	(j)	XRD-test	X-ray Diffraction				other	<u>Other Bldg./その他建</u> 惣	08:30:00	17:15:00
	(j)	X-ray Photoelectron Spectroscopy(XPS)-Fa	PHI VersaProbe 3-FS- OFC	636-JSIA040314:光電子分光装 置(XPS、ESCA)	ULVAC-PHI, Inc.	PHI VersaProbe 3	<u>Suzukakedai/すずかけ台</u>	<u>G3 Bldg./G3棟</u>	00:00:00	23:59:59
	(j)	X-ray DSC (XRD-DSC)-Materials Analysis D	XRD-DSC-MA-OFC	636-JSIA040301:X線回折装置	Rigaku	XRD-DSC	Suzukakedai/すずかけ台	R1 Bldg./R1棟	09:00:00	17:00:00
	(i)	X-ray diffraction for thin film- Material	X'Pert pro MRD-MA- OFC	636-JSIA040301:X線回折装置	PANalytical	X'Pert pro MRD	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>South Bldg, 7/大岡山南</u> <u>7号館</u>	09:00:00	17:00:00
	(j)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AD-325L LN1W-DM- OFC	32181:放電加工機	Sodick	AD-325L LN1W	Ookayama/大圈山	<u>Ishikawadai Bldg, 5/石</u> 川台5号館	09:00:00	17:00:00
	(i)	Wire EDM-Design and Manufacturing Divisi	AQ325L-DM-OFC	32181:放電加工機	Sodick	AQ325L	<u>Ookayama/大岡山</u>	<u>Ishikawadai Bldg. 5/石</u> 川台5号館	09:00:00	17:00:00